



РАСПИСАНИЕ
По курсу повышения квалификации «Методологические основы патентных исследований»
23.11.2020-25.11.2020
(очное обучение)

ДАТА, аудитория	ВРЕМЯ	ТЕМА	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
23.11.2020 г Понедельник Бережковская наб., д.24 Аудитория 425Б	10.00-10.30	Приветственное слово от ФГБУ ФИПС Инструктаж внешних слушателей по правилам внутреннего распорядка и противопожарной безопасности	Монастырский Д.В.
	10.30-11.15 11.20-12.05 12.10-12.55 13.00-13.45	Основные понятия и определения. Нормативно-правовая база патентных исследований. Роль патентных исследований в обеспечении конкурентоспособности продукции Этапы проведения патентных исследований. Разработка задания на проведение патентных исследований. Разработка регламента поиска информации	Шведова В.В.
	13.45-14.30	ОБЕД	-----
	14.30-15.15 15.20 – 16.05 16.10-16.55	Проведение поиска в патентных базах данных онлайн	Т.Д. Васильева

<p>24.11.2020 Вторник</p> <p>Бережковская наб., д.24, стр1 Аудитория 425Б</p>	10.00-10.45 10.50-11.35 11.45-12.30 12.35-13.20	<p>Систематизация и анализ отобранной информации. Отчет о патентных исследованиях – структура и содержание Основные виды (задачи) патентных исследований на различных стадиях жизненного цикла объекта исследования Исследование технического уровня объекта. Выявление ведущих стран и фирм. Исследование требований потребителей к продукции данного вида</p>	<p>Шведова В.В.</p>
	13.20-14.05	ОБЕД	
	14.05-14.50 14.55-15.40	<p>Выявление тенденций развития объекта и прогнозирование значений показателей и перспективных направлений развития технических средств. Методы прогнозирования</p>	
	15.45-16.50 16.55-17.30	<p>Исследование уровня техники с целью исключения дублирования, повышения конкурентоспособности продукции и возможности получения правовой охраны</p>	
<p>25.11.2020 Среда</p> <p>Бережковская наб., д .24 стр.1 Аудитория 425Б</p>	10.00-10.45 10.50-11.35	<p>Исследование патентной чистоты объекта. Основные понятия и определения, нормативно-правовая база</p>	<p>Шведова В.В.</p>
	11.45-12.30 12.35-13.20	<p>Методика исследования патентной чистоты объекта</p>	
	13.20-14.05	ОБЕД	
	14.05-14.50 14.55-15.40 15.45-16.50	<p>Методика исследования патентной чистоты объекта Патентный формуляр</p>	
	16.55-18.00	ЭКЗАМЕН	

Примечание: В случае внесения изменений в расписание, информация будет оперативно доведена до всех заинтересованных лиц.